

출력 일자: 2003/7/1

발송번호 : 9-5-2003-025200378

수신 : 서울 서초구 서초2동 1338-22 성지빌딩

발송일자 : 2003.06.30

206호

제출기일 : 2003.08.31

허진석 귀하

137-860

특허청 의견제출통지서

출원인 명칭 주성엔지니어링(주) (출원인코드: 119980967430)

주소 경기 광주군 오포면 능평리 49

대리인 성명 허진석

주소 서울 서초구 서초2동 1338-22 성지빌딩 206호

출원번호 10-2001-0043076

발명의 명칭 멀티 홀 앤글드 가스분사 시스템을 갖는 반도체소자제조장치

이 출원에 대한 심사결과 아래와 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조의 규정에 의하여 이를 묵지하
오나 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일까지 의견서[특허법시행규칙 별지 제25호
의2서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제5호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.(상기 제출
기일에 대하여 매회 1월 단위로 연장을 신청할 수 있으며, 이 신청에 대하여 별도의 기간연장승인통
지는 하지 않습니다.)

[이유]

이 출원의 특허청구범위 전항에 기재된 발명은 그 출원전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의
지식을 가진 자가 아래에 지적한 것에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2
항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없습니다.

1. 본원 발명은 가스 인젝터용 별도로 부착함이 없이 챔버벽에 멀티 홀 앤글드 가스분사 시스템을
바로 형성시키고, 가스가 균일한 압력과 속도로 분사되도록 하는 이중유로로 구성된 멀티 홀 앤글드
가스분사 시스템을 갖는 반도체 소자 제조장치에 관한 것이다. 인용발명(한국공개실용신안공보 제
1996-6318호)도 일반적인 가스분사장치를 구성하는 분사관의 상부 중심부에 구성된 가스 분사구와,
그 외곽부의 가스통로를 연결하는 가스유입로를 다수 구성하여 가스통로의 일측으로 유입된 가스가
가스 유입로를 통해 중심부의 가수 분사구로 배출되도록 한 것을 특징으로 하는 가스 분사장치에 관
한 것으로서, 본원 발명과 기술적 사상 및 구성이 동일범주에 속하므로, 본원 발명은 본원 발명의
기술적 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것입니다.

[참 부]

참부! 한국공개실용공보 1996-6318호(1996.02.17) 1부 공.

2003.06.30

특허청

심사4국

반도체1심사담당관실

심사관 이선택



출력 일자: 2003/7/1

<<안내>>

귀하께서는 특허법 제47조제2항의 규정에 의거 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위내에서 명세서 등을 보정할 수 있음을 알려드립니다. 문의사항이 있으시면 ☎ 042-481-5880 로 문의하시기 바랍니다.

특허청 직원 모두는 깨끗한 특허행정 구현을 위하여 최선을 다하고 있습니다. 한일 업무처리과정에서 직원 의 부조리행위
기 있으면 신고하여 주시기 바랍니다.

▶ 홈페이지(www.kipo.go.kr)내 부조리신고센터